

П
0-02

Том 80

Номер 9

Сентябрь 2013

ОПТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Выходит на русском и английском языках

•

JOURNAL
OF
OPTICAL TECHNOLOGY

Volume 80

Number 9

September 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА

- 3 Performance Evaluation of Optical Add Drop Multiplexers with Mach-Zehnder interferometer Techniques for Dense Wavelength Division Multiplexed System
Оценка характеристик оптических мультиплексоров на базе интерферометра Маха-Цендера для волоконных систем с плотным спектральным уплотнением
Sanjeev Dewra, Dr. R.S. Kale

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА И ТЕХНИКА

- 11 Исследование кинетики электропроводности кристаллов КТР, применяемых в модуляторах твердотельных лазеров
Русов В.А., Захаров Н.А., Каплун А.Б., Мешалкин А.Б., Горчаков А.В.

РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- 17 Выбор оптимальной конструкции оптического затвора на λ -ячейке
Симоненко Г.В., Студенцов С.А., Ежов В.А.
- 23 Измерение инструментальной поляризации, вносимой катадиоптрическим объективом
Савикин А.П., Шутов А.М.
- 27 Концепция построения оптической схемы панорамного стокс-поляриметра для малых телескопов
Синявский И.И., Иванов Ю.С., Видьмаченко А.П.
- 33 The choice method of light source radius in X ray phase contrast imagins system
Выбор радиуса источника в фазовоконтрастном методе формирования рентгеновских изображений
Jie Wu

ОПТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

- 39 Автоколлимационный нуль-индикатор: разработка и применение в динамической гониометрии
Ларичев Р.А., Филатов Ю.В.

- 45 **Оптический цифровой автоматизированный измеритель отклонений от прямолинейности**
Королев А.Н., Лукин А.Я., Полищук Г.С., Трегуб В.П.
- 51 **Телевизионная аппаратура для работы в условиях высоких радиационных полей**
Сенаторов В.Н., Катунин Е.И.
- 54 **Математическое моделирование регистрируемых сигналов в медицинской лазерной неинвазивной флюоресцентной диагностике**
Рогаткин Д.А., Смирнова О.Д.

ОПТИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

- 61 **Сравнительный анализ критериев устойчивости интерференционных покрытий**
Котликов Е.Н., Новикова Ю.А.
- 68 **Изменение шероховатости поверхности CVD-ZnSe при механической обработке в зависимости от размера зерна суспензии**
Вилкова Е.Ю., Тимофеев О.В., Носов С.А., Дубовой А.Н.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

- 73 **Новый метод формирования литографической маски или рельефа непосредственно в процессе электронно-лучевого экспонирования резиста**
Брук М.А., Жихарев Е.Н., Кальнов В.А., Спирин А.В., Стрельцов Д.Р.

Научный редактор *Н. Ф. Соболева*
Компьютерная верстка *Е. Г. Аран*

Сдано в набор 16.07.2013. Подписано в печать 15.07.2013. Формат бумаги 60x84/8.

Бумага офсетная. Гарнитура SchoolBookC. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 8,8. Тираж 270 экз. Заказ №1619. Цена подписная.

Отпечатано: Центр распределенных издательских систем НИУ ИТМО

Типография на Биржевой
199034, СПб, В.О., Биржевая линия, д. 16
тел. +7 (812) 915-14-54 e-mail: zakaz@TiBir.ru
